

公開番号 又は 特許番号	特許 5369209
発明名称	マルチプローブ、記録装置、及びマルチプローブの製造方法
出願人 又は 権利者	東芝、東京大学
想定デバイス	アンビエントデバイス、その他
要約	<p>【利用分野】 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) メモリに用いられるマルチプローブに関するもの。</p> <p>【発明の内容】 各マイクロプローブを個別に制御可能なマルチプローブを安価かつ容易に作製できること。そのために、表面にベース電極を有する土台と、前記土台から突出し、かつ第1の方向に並列してなる複数のマイクロプローブとを有するマルチプローブが提供される。前記マイクロプローブの少なくともいずれかは、カンチレバー、第1電極層、第2電極層を有し、前記第1電極層、および前記第2電極層の一の部分は前記カンチレバーの第1主面に形成され、かつ、前記第1電極層および前記第2電極層の一の部分は電氣的に接続し、前記第2電極層の一の部分および前記ベース電極は電氣的に接続し、前記第1主面は前記第1の方向に直交する面として規定され、前記第1の方向とは異なる第2の方向に直交する面として第2主面が規定される。</p>
図面	